

Title (en)

Mounting arrangement of a metal film resistor of an anemometric measuring device within an exhaust gas conduit

Title (de)

Anordnung eines Schichtwiderstandes einer anemometrischen Messeinrichtung in einem Abgasrohr

Title (fr)

Assemblage d'une résistance à couche métallique d'un système de mesure anémométrique dans un tuyau d'échappement

Publication

**EP 2251651 A2 20101117 (DE)**

Application

**EP 10009166 A 20080423**

Priority

- EP 08735363 A 20080423
- DE 102007020084 A 20070426

Abstract (en)

The arrangement has a film resistor (2) that is mounted in a support (3) i.e. hollow body. The support is sealed against a shield (4a) or a housing (4b) that is tightly connected to an exhaust pipe or an exhaust gas recirculation pipe. The support and the shield or the housing are sealed at a distance against each other radially outside the exhaust pipe or the recirculation pipe. The film resistor is protruded in the exhaust pipe or the recirculation pipe. Electrical lines for the resistor are arranged in a longitudinal direction of the support. Independent claims are also included for the following: (1) a method for manufacturing a measuring device (2) a method for self cleaning of a hot film anemometer (3) a method for manufacturing a hot film anemometer.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft die Anordnung eines Schichtwiderstands (Chip) in einem Abgasrohr oder Abgasrückführrohr, wobei der Schichtwiderstand in einem Träger befestigt ist, der gegen eine Abschirmung oder ein Gehäuse abgedichtet ist, die oder das dicht mit dem Abgasrohr oder Abgasrückführrohr verbunden ist, wobei der Träger und die Abschirmung oder das Gehäuse radial außerhalb des Abgasrohrs oder Abgasrückführrohrs von diesem beabstandet gegeneinander abgedichtet sind.

IPC 8 full level

**G01F 1/684** (2006.01); **F02M 25/07** (2006.01); **G01F 1/692** (2006.01); **G01F 1/698** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**F02M 26/22** (2016.02 - EP US); **F02M 26/23** (2016.02 - EP US); **G01F 1/6842** (2013.01 - EP US); **G01F 1/692** (2013.01 - EP US); **G01F 1/6983** (2013.01 - EP US); **F02M 2026/003** (2016.02 - EP US); **Y10T 29/49083** (2015.01 - EP US)

Cited by

EP2492649A1; US8943913B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA MK RS

DOCDB simple family (publication)

**WO 2008131890 A2 20081106**; **WO 2008131890 A3 20090604**; EP 2140232 A2 20100106; EP 2251651 A2 20101117; EP 2251651 A3 20120222; JP 2010525344 A 20100722; US 2010170483 A1 20100708

DOCDB simple family (application)

**EP 2008003236 W 20080423**; EP 08735363 A 20080423; EP 10009166 A 20080423; JP 2010504525 A 20080423; US 59762808 D 20080423